

⑨ 利用計画 : 先端技術センターの設備・実験室等の利用計画(日程含む)を具体的に記入してください。また、工作依頼品の概要・利用する測定器・ソフト等についても記入してください。必要に応じて添付資料を提出してください。
(注意事項) : とくに大物を搬入、設置する場合や工事が必要になる可能性がある場合は、必ず記入して下さい。とくに大型実験機器の設置については、付属機器も含めた大体の配置図等を添付して提出してください。

極低温(2K)環境下にて波長20-200umでの光学試験に供される金属平面鏡(鏡面エリア 最大 50 mm x 50 mm程度)を、超精密加工により作製する。

作製した平面鏡の面形状、面粗さをレーザー干渉計にて測定する。

スケジュール

2017年11月～ 打ち合わせ

2017年12月～ 材料手配、荒加工

2018年01月～ 超精密加工

2018年02月～ 鏡面精度評価

⑩ 国立天文台内のプロジェクトとの関連(なければ記入不要)

⑪ 国立天文台内該当プロジェクト長の推薦(なければ記入不要)

⑫ 共同開発研究を希望する場合、研究分担案などを記入してください。

内山瑞穂:冷却光学系検討

岡田則夫:超精密加工検討

磯部直樹:光学系検討、3D測定

和田武彦:開発責任者